

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 07-022500

(43)Date of publication of application : 24.01.1995

(51)Int.Cl.

H01L 21/68
H01L 21/205

(21)Application number : 05-185517

(71)Applicant : TOKYO ELECTRON LTD

(22)Date of filing : 29.06.1993

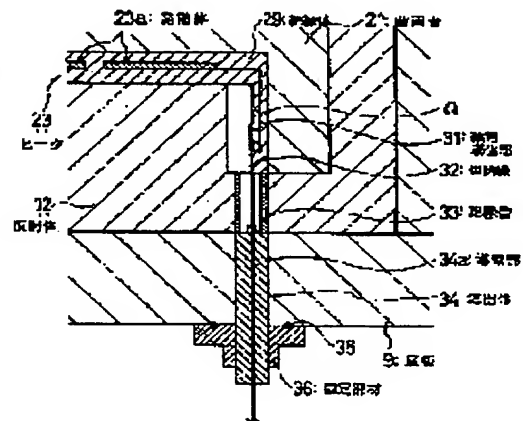
(72)Inventor : ARAMI JIYUNICHI
DEGUCHI YOICHI

(54) TREATING DEVICE

(57)Abstract:

PURPOSE: To provide a treating device which does not contaminate treating chamber inside even a subject to be processed is treated in the chamber at a high degree of vacuum at a high temperature.

CONSTITUTION: A feeding conductor 31 for a heater 23 is arranged in a treating chamber by directly exposing to the atmosphere in the chamber and a supplying line 32 is connected to the feeding conductor 31 and suppress power. The feeding conductor 31 and the supplying line 32 are constituted of carbon. Since carbon is non-metal, it does not cause metal contamination even at a high degree of vacuum at a high temperature and the atmosphere in the heating chamber is not contaminated.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

3.

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平7-22500

(43) 公開日 平成7年(1995)1月24日

(51) Int.Cl. ⁸	識別記号	庁内整理番号	F I	技術表示箇所
H 0 1 L 21/68		R		
21/205				

審査請求 未請求 請求項の数1 F D (全15頁)

(21) 出願番号 特願平5-185517

(22) 出願日 平成5年(1993)6月29日

(71) 出願人 000219967

東京エレクトロン株式会社

東京都港区赤坂5丁目3番6号

(72) 発明者 荒見 淳一

東京都新宿区西新宿2丁目3番1号 東京

エレクトロン株式会社内

(72) 発明者 出口 洋一

東京都新宿区西新宿2丁目3番1号 東京

エレクトロン株式会社内

(74) 代理人 弁理士 金本 哲男 (外1名)

(54) 【発明の名称】 処理装置

(57) 【要約】

【目的】 高真空度、高温の処理室内で被処理体を処理しても処理室内を汚染させない処理装置を得る。

【構成】 処理室内に位置し、この処理室内雰囲気と直接曝されているヒータ23の給電導体部31と、この給電導体部31に接続されて電力を供給する供給線32の材質をカーボンで構成する。

【効果】 カーボンは非金属であるから、高真空度、高温の下でもメタルコンタミネーションを発生させることなく、処理室内の雰囲気汚染させない。

